

装置番号	装置名	設置場所	分類	機器利用		技術補助		技術代行	
				バッチ課金	枚葉課金	バッチ課金	枚葉課金	バッチ課金	枚葉課金
				円/処理	円/ウエハ	円/処理	円/ウエハ	円/処理	円/ウエハ
COL001	ゲート金属スパッタ成膜装置（スパッタ装置A室）	4Fクリーンルーム	成膜装置		2,800		5,600		5,600
COL002	配線金属スパッタ成膜装置（スパッタ装置B室）	4Fクリーンルーム	成膜装置		2,800		5,600		5,600
COL003	プラズマポリシリコン成膜装置	4Fクリーンルーム	成膜装置		2,800		5,600		5,600
COL004	プラズマ絶縁膜成膜装置	4Fクリーンルーム	成膜装置		2,800		5,600		5,600
COL005	半導体酸化膜エッチング装置	4Fクリーンルーム	エッチング装置		2,800		5,600		5,600
COL006	金属エッチング装置	4Fクリーンルーム	エッチング装置		2,800		5,600		5,600
COL007	アッシング装置（MAS装置A室）	4Fクリーンルーム	エッチング装置		2,800		5,600		5,600
COL008	等方性エッチング装置（MAS装置B室）	4Fクリーンルーム	エッチング装置		2,800		5,600		5,600
COL009	原子層堆積装置(ALD)	4Fクリーンルーム	成膜装置		2,800		5,600		5,600
COL010	自動洗浄装置	4Fクリーンルーム	ウェット処理装置		3,000		6,000		6,000
COL011	酸化炉（横型三段炉上段）	4Fクリーンルーム	熱処理装置	14,000		28,000		28,000	
COL012	加熱炉（横型三段炉中段）	4Fクリーンルーム	熱処理装置	14,000		28,000		28,000	
COL013	水素シンター炉（横型三段炉下段）	4Fクリーンルーム	熱処理装置	14,000		28,000		28,000	
COL014	熱ポリシリコン成膜装置	4Fクリーンルーム	成膜装置	14,000		28,000		28,000	
COL015	熱窒化膜成膜装置	4Fクリーンルーム	成膜装置	14,000		28,000		28,000	
COL016	急速加熱装置(RTA)	4Fクリーンルーム	熱処理装置		2,800		5,600		5,600
COL017	電子線描画装置	4Fクリーンルーム	リソグラフィ装置		10,500		21,000		21,000
COL018	レジスト塗布・現像装置	4Fクリーンルーム	ウェット処理装置		3,000		6,000		6,000
COL019	マスクレス露光装置	4Fクリーンルーム	リソグラフィ装置		10,500		21,000		21,000
COL020	エピタキシャル成長装置	3Fクリーンブース	結晶成長装置		19,500		39,000		39,000
COL021	フラッシュランプアニール装置(FLA)	3Fクリーンブース	熱処理装置		2,800		5,600		5,600

バッチ課金：最大25枚まで同時に一括処理可能なバッチ式処理装置に対する課金

枚葉課金：ウエハ1枚ずつ処理を行う枚葉処理装置に対する課金

- (注1) 本年度は有償トレーニング制度は設けていませんが、次年度以降複数装置について設ける可能性があります。
- (注2) 技術代行はCOLOMODEスタッフが作業の代行を行います、成功を保証するものではありませんのでご注意ください。
- (注3) COLOMODEよりウエハの支給を受ける場合、別表1の通りの料金を申し受けます。
- (注4) COLOMODEの保有する分析装置・ドラフトチャンバーは、単独利用は不可となります。流動ロットの分析に用いる場合に限り、無償で利用可能です。
- (注5) 電子線描画装置およびマスクレス露光装置のデータ作成代行については、別表2の通りの料金を申し受けます。
- (注6) 独自のプロセスレシピを作成する場合、レシピをCOLOMODEに提供する場合に限り、作成に関わる装置利用料は無料です。
- (注7) 4インチウエハ以外のウエハを利用する場合、装置によっては別表3の装置設定代替作業代行費用の料金を申し受けます。
- (注8) COLOMODEスタッフが他施設（SCRなど産総研の他の共用施設）装置の技術代行を行う場合は、当該施設の定める機器利用料に加え、一律9,600円（税抜）を加算致します。

別表1 ウエハ料金表（税抜）

種別番号	種別	料金（円/枚）
W01	バルクウエハ・レーザー刻印付き	3,200
W02	SOIウエハ・レーザー刻印付き	38,000
W03	バルクウエハ・基準マーク形成済	26,700
W04	SOIウエハ・基準マーク形成済	61,500

別表2 データ作成代行料金表（税抜）

装置番号	装置名	料金（円）
COL016	電子線描画装置	21,000
COL018	マスクレス露光装置	21,000

※ パターンファイルはGDSファイル渡し（ダイサイズ1cm角）

※ ダイ配置はCOLOMODE標準配置以外は不可

別表3 装置設定代替作業代行費用（税抜）

装置番号	装置名	料金（円）
COL016	電子線描画装置	18,000

・課金係数について

ユーザーにより、機器利用・技術補助・技術代行の課金額に下記の係数が掛かります。

その他、支援形態によって課金額が変わることがございます。詳しくはCOLOMODEヘッドクォーターにお問い合わせください。

中小企業割引：中小企業（中小企業支援法第2条参照）による利用 0.5

研究規模割引：配賦総額が平均1000万円/年未満である競争的研究資金課題における利用 0.5

（※ 科学研究費助成事業データベースなどの公開情報が掲載されるホームページで判断可能な案件に限る）

上記割引に該当しない案件：1

・人頭経費について

本表記載事項の他に、来所して装置をご利用頂く場合、ユーザーのご所属により連携研究等経費算定要領別表第3に定める人頭経費を徴収させて頂いております。

詳細はCOLOMODEヘッドクォーターにお問い合わせください。

・利用料等についての補足

本表記載事項の他に、共用施設等利用約款に基づき、以下の料金を徴収させて頂く場合がございます。詳細はCOLOMODEヘッドクォーターにお問い合わせください。

◇追加料金

追加的に必要な作業等が発生した場合に徴収する以下に記載の料金（共用施設等利用約款（第6条第1項第5号））

ア 改造費：共用施設等を改造するために必要な費用で、具体的な改造工事の内容により実費相当額を算定して積算した額

イ 復元費：改造又は変造した共用施設等を原状復帰させるために必要な費用で、具体的な復元工事の内容により実費相当額を算定して積算した額

ウ 他の共用施設等の利用に係る経費：共用施設利用約款第3条第2項の規定により利用契約が成立した共用施設等の利用目的の達成に資するために、当該共用施設等以外の共用施設等を用いる場合の共用施設等使用料並びに研究所の従業員等による操作、運転、技術指導及び技術代行等が追加的に必要な場合の費用の額

エ 研究所以外の機関の施設等の利用に関する経費：共用施設利用約款第3条第2項の規定により利用契約が成立した共用施設等の利用目的の達成に資するために、研究所以外の第三者機関

（民間企業を含む。以下同じ。）の施設等を用いる場合の施設利用料並びに当該第三者機関の従業員等による操作、運転、技術指導及び技術代行等が追加的に必要な場合の費用の額

オ 上記エの場合における研究所の従業員等の従事する経費：上記エの場合における研究所の従業員等による操作、運転、観察、分析、解析、加工、試料作製等が追加的に必要な場合の費用の額

カ その他実費：共用施設等の利用に際し、研究所において追加的な購入が必要となる器具、材料、薬品その他の消耗品及び第三者機関へ外注する評価、分析、技術代行その他の役務であって、あらかじめ研究所と利用者が費用負担について合意した費用の額

◇運営管理費（第6条第1項第6号）

利用料金（共用施設等使用料、運転費、技術指導費、技術代行費、追加料金の合計）額に15パーセントを乗じた額